

王浪平

工学博士

焊接科学与工程系主任；先进焊接与连接国家重点实验室副主任

教授；博士生导师

+86-451-86418729

aplpwang@hit.edu.cn

主要研究方向

离子注入与沉积技术

电子束蒸发镀膜技术

社会兼职

中国电工学会 电子束离子束专业委员会 委员

中国焊接学会 堆焊及表面工程专业委员会 委员

主要学术成果

1. **Wang, LP**, Lu, Y, Wang XF, Ion implantation and energy loss effect during high-voltage pulsed glow discharge in a tube. *Applied Physics Letters*, 2009, 95 (10): 101501 (SCI, 影响因子: 3.554)
2. **Wang, LP**, Huang, L, Wang, YH, Duplex DLC coatings fabricated on the inner surface of a tube using plasma immersion ion implantation and deposition, *Diamond and Related Materials*, 2008, 17(1): 43 - 47(SCI, 影响因子: 2.092)
3. **Wang, LP**, Huang, L, Xie, ZW, Fourth-generation plasma immersion ion implantation and deposition facility for hybrid surface modification layer fabrication, *Review of Scientific Instruments*, 2008, 79(2): 023306, (SCI, 影响因子: 1.738)
4. 王浪平, 王小峰, 陆洋. 全方位离子注入与沉积批量复合处理装置及方法. 授权号: ZL200810063852.X
5. 王浪平等, 全方位*****, 国防科技进步二等奖, 2008